

粉体の表面を均一に改質する 『真空粉体攪拌処理装置』

電子技研

電子技研(東大阪市市川田四一六四、☎〇七二一九三二〇〇六)は、十月十四日～十六日までインテックス大阪で開催された「粉体工業展」に、「真空プラズマ粉体攪拌処理装置」などを出展し、好評を博した。

「基板用平行平板プラズマ処理装置」は、中型液晶基板やプリント基板のアッシング、デスミア、表面改質、エッチングなどのプラズマ処理が行える処理装置。チャンバー手動開閉式研究開発

③エッチング(ヒュアな活性表面の露出) ④還元(酸化膜の除去) ⑤官能基付与 など様々なメ

同社では、半導体やLCDなどを中心とした電子部品の関連業務などで活躍するプラズマ処理装置の開発・製造を行っている。

同社では、同装置以外にも多くのプラズマ処理装置はもちろん、その関連製品を取り扱っている。そのいくつかを紹介すると――

プラズマ処理装置とは、各種プラズマを用いて、対象物の剥離から有機物の除去、表面改質による親水性の向上など様々な用途で利用される装置である。

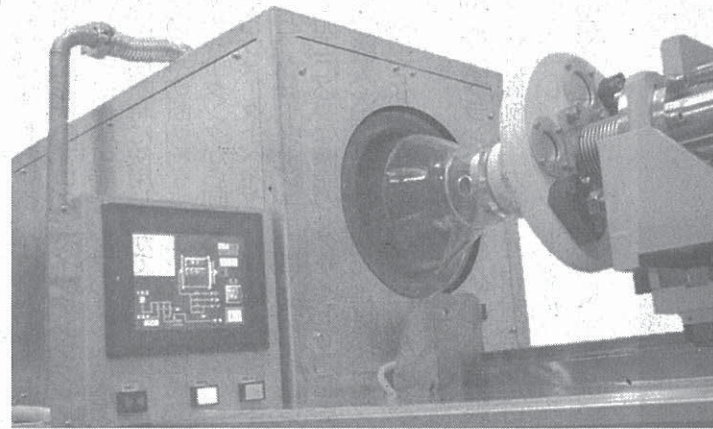
活躍の場は広く、①プラズマエッチング・アッシング②電子デバイス向け薄膜などの微細加工③

「バレルタイププラズマ処理装置」は、等方形プラズマにより対象物の形状に因らず全方向から処理を行う処理装置。ミクロンオーダーの微細なパターンや多孔質形状内面の洗浄や改質に効果を発揮する。ウエハまたは小型基板のアッシングや等方形エッチング、表面改質に最適である。

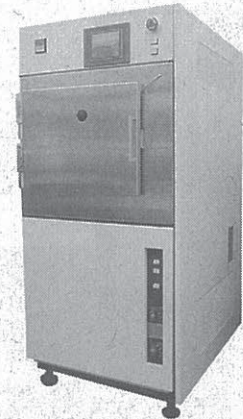
プラズマを用いて 粉体に機能を付与!

式から選択可能。目的の表面改質に合わせた最適

「真空プラズマ粉体攪拌処理装置」は、プラズマを利用して微粒子の表面を均一に改質して、粉体に様々な機能を付加する装置である。



真空プラズマ粉体攪拌処理装置



バレルタイププラズマ処理装置

用タイプから大気ゲート、搬送機構、ガスステーションを増設した全自動システムの製造にも対応している。
<http://www.denshigik.co.jp>